PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-133799

(43)Date of publication of application: 18.05.2001

(51)Int.Cl.

G02F 1/1341

(21)Application number: 11-315925

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

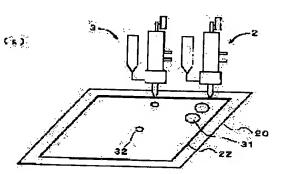
05.11.1999

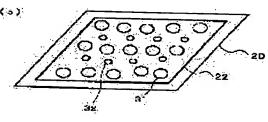
(72)Inventor: MURATA SATOSHI

(54) METHOD OF PRODUCING LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of producing liquid crystal display device using a drop injection method by which a liquid crystal can be dropped in a short time while the dropping amount of the liquid crystal is optimally controlled. SOLUTION: A liquid crystal is dropped onto the alignment film on the surface of an array substrate 20 by using two dispensers 2, 3 together. The dispenser 2 can drop 5 mg of the liquid crystal per one shot, while the dispenser 3 can drop 2 mg of the liquid crystal per one shot. The liquid crystal is dropped inside of the sealing agent 22 applied in a frame state around the display region of the array substrate 20 as shown in the Fig. 2 (a) by using the two dispensers 2, 3 at a time. Fig. 2 (b) shows the state of the liquid crystal dropped inside of the sealing agent 22 on the array substrate 20 in such a manner that liquid crystal drops 31 are deposited in an almost equal quantity at positions each having an almost equal diffusion distance from adjacent drops and that liquid crystal drops 32 each in 2 mg amount which is smaller than the dropping amount (5 mg) of the liquid crystal drop 31 is deposited at the positions where the diffusion





of the liquid crystal is thin between the liquid crystal drops 31 adjacent to each other.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

05.11.2003

[Date of sending the examiner's decision of

05.10.2004

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

2004-22599

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

04.11.2004

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-133799 (P2001 - 133799A)

(43)公開日 平成13年5月18日(2001.5.18)

(51) Int.Cl.

識別記号

G02F 1/1341 FΙ

G02F 1/1341 テーマコート*(参考) 2H089

審査請求 未請求 請求項の数5 〇L (全 6 頁)

(21)出願番号

特顏平11-315925

(22)出窟日

平成11年11月5日(1999.11.5)

(71) 出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号,

(72)発明者 村田 職

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(74)代理人 100101214

弁理士 森岡 正樹

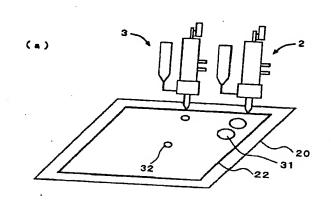
Fターム(参考) 2H089 NA22 NA42 QA12 QA14

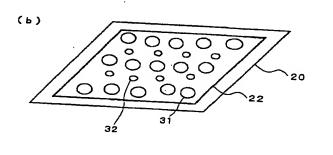
(54) 【発明の名称】 液晶表示装置の製造方法

(57)【要約】

【課題】本発明は、液晶の滴下量を最適に制御し、且つ 短時間で滴下できる滴下注入法を用いた液晶表示装置の 製造方法を提供することを目的とする。

【解決手段】2本のディスペンサ2、3を一緒に用いて アレイ基板20表面の配向膜上に液晶を滴下する。 ディ スペンサ2は1ショット当り5mgの液晶を滴下でき、 ディスペンサ3は1ショット当り2mgの液晶を滴下で きる。これら2つのディスペンサ2、3を同時に用い て、図2(a)に示すように、アレイ基板20の表示領 域外周囲に枠状に塗布されたシール剤22の内方に液晶 を満下する。図2(b)は、シール剤22内のアレイ基 板20面上に、隣接する液滴間の拡散距離がほぼ等しく なる位置にほぼ同量の液晶31の滴下を行い、隣り合う 液晶31間で液晶拡散が疎となる位置に液晶31の滴下 量(5mg)より少ない2mgの液晶32を滴下した状 態を示している。





【特許請求の範囲】

【請求項1】基板上に液晶を滴下し、前記基板の液晶滴 下面側を対向基板に対向させて真空中で貼り合わせてか ら大気圧に戻すことにより液晶注入を行う滴下注入法を 用いた液晶表示装置の製造方法において、

前記基板上に前記液晶を滴下する際、複数のディスペン サを用いることを特徴とする液晶表示装置の製造方法。 【請求項2】請求項1記載の液晶表示装置の製造方法に おいて、

前記複数のディスペンサは、1ショット当りの液晶滴下 量が異なることを特徴とする液晶表示装置の製造方法。 【請求項3】基板上に液晶を滴下し、前記基板の液晶滴 下面側を対向基板に対向させて真空中で貼り合わせてか ら大気圧に戻すことにより液晶注入を行う滴下注入法を 用いた液晶表示装置の製造方法において、

前記基板上の液晶滴下位置を連続的に移動させながら前 記液晶を連続的に満下し、満下された前記液晶を前記基 板上で流動させて拡散させることを特徴とする液晶表示 装置の製造方法。

【請求項4】請求項3記載の液晶表示装置の製造方法に 20 おいて、

前記液晶を複数のノズルを介して滴下することを特徴と する液晶表示装置の製造方法。

【請求項5】請求項3又は4に記載の液晶表示装置の製 造方法において、

前記基板を水平方向に対し0・以上85・以下の範囲で 傾けて前記液晶を滴下することを特徴とする液晶表示装 置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置(L iquid Crystal Display;LC D)の製造方法に関し、特に、液晶を基板間に封止する 際に滴下注入法を用いた液晶表示装置の製造方法に関す る。

[0002]

【従来の技術】薄膜トランジスタ (TFT) をスイッチ ング素子として用いたアクティブマトリクス型のカラー 液晶表示装置はフラットパネルディスプレイの主流とし て注目され、高品質で大量生産できる製造方法が要求さ れている。液晶表示装置の製造工程は大別すると、ガラ ス基板上に配線パターンや薄膜トランジスタ(TFT) 等のスイッチング素子 (アクティブマトリクス型の場 合)等を形成するアレイ工程と、配向処理やスペーサの 配置、及び対向するガラス基板間に液晶を封入するセル 工程と、ドライバICの取付けやバックライト装着など を行うモジュール工程からなる。このうちセル工程で行 われる液晶注入プロセスでは、例えばTFTが形成され たアレイ基板と、それに対向してカラーフィルタ (C F)等が形成された対向基板とをシール剤を介して貼り 50

合わせた後シール剤を硬化させ、次いで液晶と基板とを 真空槽に入れてシール剤に開口した注入口を液晶に浸け てから槽内を大気圧に戻すことにより基板間に液晶を封 入する方法(真空注入法)が用いられている。

【0003】それに対し近年、例えばアレイ基板周囲に 枠状に形成したシール剤の枠内の基板面上に規定量の液 晶を滴下し、真空中でアレイ基板と対向基板とを貼り合 せて液晶封入を行う滴下注入法が注目されている。滴下 注入法による液晶表示パネルの製造工程について簡単に 説明する。まず、TFT等のスイッチング素子が形成さ れたアレイ基板面の複数箇所に、図示しない液晶滴下注 入装置から液晶を滴下する。次いで、表示領域内に共通 (コモン) 電極やカラーフィルタが形成され、表示領域 外周囲に紫外線(UV)照射により硬化するシール剤等 が塗布された対向基板を位置合わせしてアレイ基板に貼 り付ける。この工程は真空中で行われる。次いで、貼り 合わせた基板を大気中に戻すと、貼り合わされたアレイ 基板と対向基板間の液晶が大気圧により拡散する。次 に、シール剤の塗布領域に沿う移動方向でUV光源を移 動させながらUV光をシール剤に照射し、シール剤を硬 化させる。

【0004】この滴下注入法は、従来のパネルの製造に 広く用いられてきた真空注入法と比較して、第1に液晶 材料の使用量を大幅に低減できること、第2に液晶注入 時間を短縮できること等から、パネル製造のコストを低 減し量産性を向上させる可能性を有しているため、パネ ル製造工程での適用が強く望まれている。 [0005]

【発明が解決しようとする課題】ところが、この滴下注 30 入法を用いた液晶表示装置の製造方法では、滴下する液 晶の量がわずかに変化してもセルギャップが変動してし まい、所定のセルギャップが得られないという問題を有 している。一方、滴下量を微妙に調整できる高精度のデ ィスペンサを用いると、予め決められた所定量の液晶を 満下することしかできないため、比較的少ない満下量に 設定されたディスペンサを用いる場合には数十点も滴下 する必要が生じてしまい、タクトが遅くなってしまうと いう問題や、多数の滴下跡がムラになり表示不良を引き 起こす恐れがあるという問題を有している。

【0006】本発明の目的は、液晶の滴下量を最適に制 御し、且つ短時間で滴下できる滴下注入法を用いた液晶 表示装置の製造方法を提供することにある。 [0007]

【課題を解決するための手段】上記目的は、基板上に液 晶を滴下し、前記基板の液晶滴下面側を対向基板に対向 させて真空中で貼り合わせてから大気圧に戻すことによ り液晶注入を行う滴下注入法を用いた液晶表示装置の製 造方法において、前記基板上に前記液晶を滴下する際、 複数のディスペンサを用いることを特徴とする液晶表示 装置の製造方法によって達成される。上記本発明の液晶

表示装置の製造方法において、前記複数のディスペンサ は、1ショット当りの液晶滴下量が異なることを特徴と する.

【0008】また、上記目的は、基板上に液晶を滴下 し、前記基板の液晶滴下面側を対向基板に対向させて真 空中で貼り合わせてから大気圧に戻すことにより液晶注 入を行う滴下注入法を用いた液晶表示装置の製造方法に おいて、前記基板上の液晶滴下位置を連続的に移動させ ながら前記液晶を連続的に滴下し、滴下された前記液晶 を前記基板上で流動させて拡散させることを特徴とする 液晶表示装置の製造方法によって達成される。上記本発 明の液晶表示装置の製造方法において、前記液晶を複数 のノズルを介して滴下することを特徴とする。また、前 記基板を水平方向に対し0・以上85・以下の範囲で傾 けて前記液晶を滴下することを特徴とする。

[0009]

【発明の実施の形態】本発明の第1の実施の形態による 液晶表示装置の製造方法を図1乃至図3を用いて説明す る。まず、本実施の形態による液晶表示装置の製造方法 で用いるフランジャーボンプ式のディスペンサの概略の 構成について図1を用いて説明する。 ディスペンサ2は 中空の円筒形状の筐体5を有しており、円筒形状の中心 軸をほぼ鉛直方向に向けて使用するようになっている。 筐体5内には、円筒形状の中心軸に沿って細長い棒状の ピストン10が鉛直方向に移動可能に支持されている。 ピストン10の先端部は、筐体5の鉛直下方端に設けら れたノズル16内方を移動することができるようになっ ている。 筐体5のノズル16近傍の側壁の開口からは、 液晶収納容器14内の液晶が供給管7を介して図示の矢 印に沿ってノズル16にまで流入できるようになってい 30 る。 ノズル16内に達した液晶はノズル16でのピスト ン10先端の移動量に依存してノズル16から滴下する ようになっており、外力を受けない限り液晶自身の表面 張力によりノズル16から吐出しないようになってい る.

【0010】筐体5内の空気室の側壁には、鉛直方向に 離れて設けられた2つの空気流入口6、8が取り付けら れている。ピストン10には空気室内を2つに分離する 隔壁12が固定されており、隔壁12はピストン10と 共に、空気流入口6、8の間の空気室内壁を摺動するこ とができるようになっている。従って隔壁12は、空気 流入口6から空気室内に空気が流入すると鉛直下方に圧 力を受けて下方に移動し、空気流入口8から空気室内に 空気が流入すると鉛直上方に圧力を受けて上方に移動す る。これにより、ピストン10を鉛直方向に所定量移動 させることができるようになっている。

【0011】空気流入口6、8は、ポンプコントローラ 26に接続されている。ポンプコントローラ26は、空 気を吸入して所定のタイミングで空気流入口6、8のい ずれかに空気を送り込むようになっている。以上説明し

た構成のディスペンサ2は、1ショット当り5mgの液 晶30を滴下するようになっている。なお、この1ショ ット当りの液晶滴下量は、筐体5上方に突出したピスト ン10に固定されたマイクロゲージ18を用いて、ビス トン10の鉛直方向の移動量を制御することにより調整 するこができるようになっている.

【0012】次に図2及び図3を用いて、本実施の形態 による液晶表示装置の製造方法について説明する。図2 (a)は、液晶滴下時の状態を示し、図2(b)は、基 板上に液晶を満下した直後の状態を示している。まず、 図2(a)に示すように、2本のディスペンサ2、3を 一緒に用いてアレイ基板20表面の配向膜上に液晶を滴 下する。ディスペンサ2は図1を用いて説明したものと 同一であり、1ショット当り5mgの液晶を滴下するよ うに調整されている。一方ディスペンサ3はディスペン サ2と同一の構造を有しているが、マイクロゲージ18 を調整して1ショット当り2mgの液晶を滴下するよう になっている。なお、図2(a)では、説明を簡略にし て理解を容易にするため、ディスペンサ2、3に空気を 送り込むポンプコントローラ26の図示は省略してあ り、また、ディスペンサ2、3間の配置関係も誇張して 描いている。

【0013】これら2つのディスペンサ2、3を同時に 用いて、図2(a)に示すように、アレイ基板20の表 示領域外周囲に枠状に塗布された、紫外線(UV)照射 により硬化するシール剤(あるいはUV照射と熱の併用 により硬化する併用型シール剤)22の内方に液晶を滴 下する。図2(b)は、シール剤22内のアレイ基板2 0面上に、隣接する液滴間の拡散距離がほぼ等しくなる 位置にほぼ同量の液晶31の滴下を行い、隣り合う液晶 31間で液晶拡散が疎となる位置に液晶31の滴下量 (5mg) より少ない 2mgの液晶32を滴下した状態 を示している。

【0014】以上説明した液晶滴下が終了したら、次 に、図3(a)に示すように、表示領域内に共通(コモ ン)電極やカラーフィルタが形成された対向基板40を 位置合わせしてアレイ基板20に貼り付ける。この工程 は真空中で行われる.次いで、貼り合わせた基板を大気 中に戻すと図3(b)に示すように、貼り合わされたア レイ基板20及び対向基板40間の液晶31、32が大 気圧により拡散する。次に、図3(c)に示すように、 シール剤22の塗布領域に沿う移動方向46でUV光源 42を移動させながらUV光44をシール剤22に照射 し、シール剤22を硬化させる。拡散した液晶34は所 定のセルギャップで2枚の基板20、40間に封止され て液晶表示パネルが完成する。

【0015】このように本実施の形態は、アレイ基板2 0上の複数箇所に液晶を滴下する際、複数のディスペン サを用いることにより液晶31、32の滴下量を滴下箇 50 所に応じて変化させることを可能にしている。以上説明

したように、液晶の滴下量、滴下パターンを2種以上に 分けて同時に液晶滴下を行うことにより液晶表示パネル 面内での液晶を迅速にほぼ一様に拡散させることができ る。液晶液滴は基板貼り合せ時に円形状に拡散するが、 液晶拡散が疎となる領域に見合った量の液晶を補填する ことにより液晶の拡散はパネル面内でほぼ一様に早くな りタクトタイムを向上させることができる。 なお、上記 実施形態では、1 ショット当りの液晶滴下量が異なるデ ィスペンサ2、3を用いたが、アレイ基板の液晶滴下面 積の大きさ等を勘案して液晶滴下量が同一のディスペン 10 サを複数用いるようにしてもタクトタイムを向上させる ことができる.

【0016】次に、本発明の第2の実施の形態による液 晶表示装置の製造方法を図4乃至図7を用いて説明す る。まず、本実施の形態による液晶表示装置の製造方法 で用いる液晶滴下装置の概略の構成について図4を用い て説明する。 図4(a)は液晶満下装置の側面を示し、 図4 (b)は同下面を示している。 図4 に示す液晶滴下 装置50は、中空の細長い直方体形状の筐体52の下面 に複数のノズル58を有している。 筐体52上面には、 図1に示したディスペンサ2を固定するディスペンサ受 け部54と、筐体52内に空気を送り込む空気供給部5 3が設けられている。空気供給部53には、空気圧調整 用のレギュレータ56と空気送り込みの開閉を制御する 電磁弁57が取り付けられている。筐体52下面のノズ ル58は、断面が円形で2mmゅのノズル径を有してお り、圧力をかけない限り表面張力により液晶が滴下しな いようになっている。複数のノズル58は隣り合う間隔 が5mmで一列に並んで設けられている。

【0017】次に、この液晶滴下装置50を用いた液晶 滴下による液晶表示装置の製造方法について図5を用い て説明する。まず、ディスペンサ受け部54にディスペ ンサ2を差し込んで固定し、ディスペンサ2から所定量 の液晶を正確に筐体52内に注入する。液晶の注入が終 わったら、液晶滴下装置50を図示しない支持移動部材 及び空気供給装置に接続する。この状態で基板を液晶滴 下装置50下方に設置し、空気供給部53から筺体52 内に空気を送り込んでノズル58から液晶を連続的に流 出させる。それと共に、液晶滴下装置50と基板とを相 対的に連続的に移動させて基板上に液晶を拡散させる。 【0018】より具体的に図3を用いて説明する。ま ず、ガラス基板41上には、配向膜が形成され表示領域 外周囲に枠状に熱併用型UVシール剤22が塗布された CF(カラーフィルタ)基板が2枚分形成されている。 長方形のガラス基板41は、長辺がX方向に、短辺がY 方向に沿って置かれた状態から、長辺の1辺を2方向 (鉛直方向)に持ち上げられて、水平方向に対して基板 全体を約5・傾けて載置されている。この状態のガラス 基板41に対して、熱併用型UVシール剤22内方であ って水平方向から持ち上げられた長辺側の上方に本実施 50

の形態による2つの液晶滴下装置50をそれぞれ配置す る。各液晶滴下装置50は、その複数のノズル58の配 置方向とガラス基板41の長辺とがほぼ平行になるよう に調整されて、図示しない支持移動部材及び空気供給装 置に接続される。この状態で空気供給部53から筐体5 2内に空気を送り込んでノズル58から液晶を連続的に 流出させる。それと共に、液晶滴下装置50がガラス基 板41の傾斜に沿って連続的に下降するように両者を相 対的に移動させてガラス基板31上に液晶35を拡散さ せる.

【0019】隣り合うノズル58から満下した液晶35 はガラス基板41に到達した時点で密着し合うので複数 のノズル58から連続滴下した液晶35は全体として、 未満下面20′との間でガラス基板41の長辺方向に線 状の境界を持ちながらガラス基板 4 1 表面を下方に流動 する.

【0020】なお、液晶滴下装置50とガラス基板41 との相対移動時に徐々に筐体52内の圧力が弱くなるよ うに空気供給部53で制御することにより、滴下された 液晶の高さもほぼ均一にすることができる。液晶滴下が 終了したガラス基板41は、接着スペーサを散布したア レイ基板と真空中で貼り合わせられ、次いで大気中に開 放されてセルギャップの形成が行われる。その後、UV 照射を行い一次硬化後、オーブンによる熱硬化でシール 剤を完全に硬化させる。次に、ガラス基板41を切断し て液晶表示パネルが完成する。

【0021】次に、図6及び図7を用いて本実施の形態。 による液晶表示装置の製造方法の変形例について説明す る。 図6 (a)は変形例に係る液晶滴下装置の下面を示 し、図6 (b) は同側断面を示している。図6 に示す液 晶滴下装置は、図4に示した液晶滴下装置50の円形の 断面を有するノズル58に代えて、スリット状のノズル 60を設けている点に特徴を有している。スリット状の ノズル60を有する液晶滴下装置50は液晶70の滴下 量が多いパネルに用いて有効である。なお、より少ない 範囲で液晶を滴下したい場合は、図7(b)に示すよう にノズル60の一部を塞ぐシャッタ62を設け、シャッ タ62の配置やシャッタ量を調整すればよい。

【0022】また、図7(a)は、他の変形例に係る液 晶滴下装置の斜視図であり、図7(b)は同側断面を示 している。図7に示す液晶滴下装置は、図4に示した液 晶滴下装置50の円形の断面を有するノズル58に代え て、半円形断面で断面積がノズル58より大きいノズル 68を設けている点に特徴を有している。ノズル68を 有する液晶滴下装置50は液晶70の滴下量が多いパネ ルに用いて有効である。さらに、図7(b)に示すよう にノズル68の液晶滴下端部にシャッタ62を設けるよ うにすれば、空気供給部53を用いた空気圧制御によら ずに液晶70を滴下することができるようになる。

【0023】本発明は、上記実施の形態に限らず種々の

変形が可能である。例えば、上記第2の実施の形態によ る液晶表示装置の製造方法において、ガラス基板41を 水平方向に対し5・傾けて液晶を滴下したが、本発明は これに限らず、水平方向に対して0° すなわち基板が水 平状態であってもよく、また、液晶滴下装置から基板へ 十分に液晶が満下できる角度の上限となる約85・以下 の範囲で適用可能である。

[0024]

【発明の効果】以上の通り、本発明によれば、液晶の滴 下量を最適に制御し、且つ短時間で満下できる満下注入 10 法を実現できる.

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態による液晶表示装置 の製造方法で用いるディスペンサを示す図である。

【図2】本発明の第1の実施の形態による液晶表示装置 の製造方法を説明する図である。

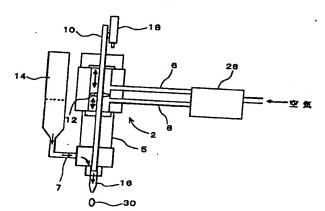
【図3】本発明の第1の実施の形態による液晶表示装置 の製造方法を説明する図である。

【図4】本発明の第2の実施の形態による液晶表示装置 の製造方法を説明する図である。

【図5】本発明の第2の実施の形態による液晶表示装置 の製造方法を説明する図である。

【図6】本発明の第2の実施の形態による液晶表示装置 の製造方法の変形例を説明する図である。

【図1】



【図7】本発明の第2の実施の形態による液晶表示装置 の製造方法の他の変形例を説明する図である。

【符号の説明】

- 2、3 ディスペンサ
- 5、52 筐体
- 6、8 空気流入口
- 10 ピストン
- 12 隔壁
- 14 液晶収容容器
- 16、58、60、68 ノズル
 - 18 マイクロゲージ
 - 20 アレイ基板
 - 22 シール剤
 - 26 ポンプコントローラ
 - 31、32、35、70 液晶
 - 40 対向基板
- 41 ガラス基板
- 42 UV光源
- 44 UV光
- 50 液晶滴下装置
 - 53 空気供給部
 - 56 レギュレータ
 - 57 電磁弁
 - 62 シャッタ

【図2】

